別記様式第３号

|  |  |
| --- | --- |
| 課題番号 |  |

装置開発室装置有償利用申請書（マテリアル成果非公開）

　年　　月　　日

　大学共同利用機関法人自然科学研究機構

　分子科学研究所長　殿

　下記のとおり貴研究所の装置を有償利用したいので申請します。

また，実施にあたり，万一の傷害等の保障に関しては，申請者と申請者の所属機関においてすべての責任を負うことを誓約します。

記

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請者 | 氏名 |  | | | |
| 所属・職名 |  | | | |
| 住所 | 〒 | | | |
| 連絡先 | TEL  e-mail | | | |
| 企業種別（※） | | □　大企業　　□　中小企業　　□　その他 | | | |
| 分野・業種等（※） | | （１～２５のうち該当する番号を記入） | | | |
| ＊・・・本様式末尾記載の基準及び一覧から選択すること | | | | | |
| 研究課題名 | |  | | | |
| 利用希望装置 | |  | | | |
| 利用希望期間 | | 年　　月　　日　～　　　年　　月　　日　（1か月以内） | | | |
| 利用希望日数及び時間数（見込み） | | 日間（　　時間） | | | |
| 放射線業務従事 | | □有　（注）有の場合は「放射線業務従事承認書」を提出してください。  □無 | | | |
| 研究の具体的方法 | |  | | | |
| 申請者の所属機関における承認  （申請者の所属機関が本申請を承認していることについてご記入ください。） | | 承認者氏名 | |  | |
| 所属・部署 | |  | |
| 職名（役職） | |  | |
| 共同利用研究者  （上限５名まで） | |  | 氏名 | 所属 | 職名 |
| １ |  |  |  |
| ２ |  |  |  |
| ３ |  |  |  |
| ４ |  |  |  |
| ５ |  |  |  |
| 不正防止に関する  誓約 | | 申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、以下のガイドライン等を理解し、これらのガイドライン・方針・規程、自身が所属する機関の規則、関連する法令等を遵守し、研究活動における特定不正行為（捏造、改ざん、盗用）、及びそれ以外の不正行為（不適切なオーサーシップ、二重投稿等）を行いません。  （１）研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（平成２６年８月２６日文部科学大臣決定）  https://www.mext.go.jp/b\_menu/houdou/26/08/\_\_icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568\_02\_1.pdf  （２）大学共同利用機関法人自然科学研究機構研究活動上の不正行為を防止するための基本方針（平成２０年２月２８日決定）  https://www.nins.jp/site/rule/1024.html  （３）大学共同利用機関法人自然科学研究機構における研究活動上の不正行為への対応に関する規程（平成２０年２月２８日自機規程第７４号）  <https://www.nins.jp/uploaded/attachment/3157.pdf>  以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。  　□　誓約します。 | | | |
| 安全管理に関する  誓約 | | 申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、分子科学研究所安全ガイド（<https://www.ims.ac.jp/about/safetyguide2021_2022.pdf>）を理解し、これらのガイドライン、自身が所属する機関の規則、労働安全衛生法等の関連する法令等を遵守し、安全と環境を常に意識しながら、研究活動における事故・災害の発生防止に努めます。  　以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。  　□　誓約します。 | | | |
| 希望事項 | |  | | | |
| その他 | | 請求書の送付先が「申請者」欄の記載情報と異なる場合は､こちらに記載ください 。  請求書に記載する宛名・住所：  請求書の送付先E-mail又は住所・ご担当者名：  請求書は，原則公印を省略し，E-mailで送付します。特に公印を押印した紙媒体の請求書が必要な場合は，以下にチェックを入れてください。  □　請求書に公印の押印が必要 | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 記載不要 | 確認者 | 確認日付 | 氏　　名 | 区分 | 職員対応時間（見込） |
| 装置開発室長 | 年　月　日 |  | □ 技術開発 |  |
| 担　当　者 | 年　月　日 |  | □ 設計製作 |  |
| □ 技術補助 |  |

【企業種別基準】

大企業　　資本金３億円以上または従業員３００人以上のどちらかに該当するもの

中小企業　資本金３億円以上または従業員３００人以上のどちらにも該当しないもの

その他　　上記に該当しないもの

【分野・業種等一覧】

１　有機材料／２　電子・磁性・金属・無機材料／３　繊維・窯業・紙・パルプ　／４　食品・飲料／５　化粧品・トイレタリー／６　医療・医薬品／７　精密機器・産業機械製造業／８　医療機器製造業／９　分析・計測機器／１０　電気・電子機器・総合電機／１１　半導体・電子部品製造業／１２　自動車・輸送・運輸機器・部品製造業／１３　鉄鋼・非鉄金属製造業／１４　商社・代理店・流通・小売業／１５　電力・ガス・石油・その他エネルギー／１６　建設・不動産／１７　情報・通信／１８　金融・投資・コンサルティング／１９　シンクタンク／２０　水産・農林・鉱業／２１　報道・メディア・出版／２２　外国公館・機関・団体／２３　官公庁・自治体・地方公共団体／２４　教育・研究機関／２５　その他